19日本国特許庁

①特許出願公開

公開特許公報

昭53—133429

Mint. Cl.2	識別記号	 日本分類	庁内整理番号	43公開 昭和	加53年(197	78)11月21日
G 03 C 1/72		103 B 1	6715—27	July Clinar	0	
B 41 M 5/00		116 A 415	7267—27	発明の数	2	
G 03 F 7/02		99(5) C 3	7113—57	審査請求	未請求	
G 03 H 1/00		59 G 4	6507—57	•		
0 00 11 2/00		103 K 0	6805—27			(全 24 頁)
H 01 L 21/312			7448—23			
H 05 K 3/06	•	104 G 0	7440-25			

☆ 報射線感受性コピー組成物及びレリーフ像の形成法

②特 願 昭53-49196

②出 願 昭53(1978) 4月24日

優先権主張 ③1977年 4 月25日 ③西ドイツ国

(DE) @P2718254.3

の発 明 者 ユルゲン・ザンダー

ドイツ連邦共和国ケルクハイム ・ベルリナー・リンク27

ゲルハルト・ブール

同

ドイツ連邦共和国ケーニツヒシ ユタイン・アム・エルトペーア シユタイン28

⑩出 願 人 ヘキスト・アクチエンゲゼルシャフト

ドイツ連邦共和国フランクフル ト・アム・マイン80

19代理 人 弁護士 ローランド・ソンデルホフ 外1名

最終頁に続く

88 AFF · 2

1 発明の名称

輻射線感受性コピー組成物及びレリーフ像の 形成法

- 2 特許請求の範囲
 - 1. 主成分として、
 - a) 化学線の作用下で酸を形成する化合物と
 - b) ・その主鎖中に繰返しアセタール 又はケタール部分を有し、現像液中でのその溶解 度が酸の作用によつて上昇する有機重合化 合物

とを含有するコピー組成物において、上配有機重合化合物のアセタール部分又はケタール部分のアルコール成分の各αー炭素原子が脂肪族である輻射線感受性コピー組成物

- 2. 重合化合物の主鎖が繰返してセタール部分 又はケタール部分を平均して少なくとも3個 含有する特許請求の範囲第1項記載のコピー
- 3. 重合化合物のアルコール成分が少なくとも

2 価のアルコールである特許請求の範囲第 1 項記載のコピー組成物

- 4. 重合化合物のアルコール成分が2~18個 の炭素原子を含有する特許請求の範囲第1項 記載のコピー組成物
- 5. 重合化合物のアルコール成分がヒドロキシアルキルエノールエーテルのヒドロキシアルキル基から誘導される特許請求の範囲第1項記載のコピー組成物
- 6. 付加的に重合体結合剤を含有する特許請求 の範囲第1項記載のコピー組成物
- 7. 重合化合物が一般式 :

〔式中:nは1~40の整数を表わし、R₁ 及びR₄ はH原子、アルキル基又はアリール 基を表わし、R₅ 及びR₅ はアルキレンオキ

特房四53-133429(2)

8. 重合化合物が一般式 [:

(式中: mは2~80の整数を表わし、R₁はH原子又はアルキル基又はアリール基を表

れぞれが基 R₂ 及び R₃ のいずれかと結合して置換又は不置換環を形成することが出来る 〕に相当する繰返し単位を含有する特許請求 の範囲第 1 項記載のコピー組成物

10. 重合化合物が一般式Ⅳ:

〔式中:1は1~40の整数を表わし、R₁及びR₁′はH原子、アルキル基又はアリール基を表わし、これは相互に結合して置換されていてもよい環を形成することが出来、R₂はケルキレン基又はアリーレン基を表わし、R₃は4価の脂肪族基を表わし、その遊離原子価は5員環又は6員環が形成される様な距離で異なる炭素原子に結合している〕に相当する単位を含有する特許療の範囲第1項記

わし、R₂ はアルキル基又はフリール基を表わすか、又はR₁ とR₂ が一緒に登換されていてもよい環を形成し、R₃ はアルキレン基を表わし、これは基R₁ 及びR₂ のいずれかと結合して置換又は不置換環を形成することが出来る〕に相当する繰返し単位を含有する特許請求の範囲第1項配載のコピー組成物

9. 重合化合物が一般式』:

$$\begin{bmatrix} R_{9} & R_{8} \\ -CH & C & -CR_{3}O & -C \end{bmatrix}_{m}$$

(式中:mは2~80の整数を表わし、R₂はH原子、アルキル基又はアリール基を表わし、R₃はアルキレン基を表わし、R₈及びR₉はH原子、アルキル基又はアリール基を表わし、これは相互に結合するか又はそのそ

載のコピー組成物

- 11. 重合化合物が同じ分子内に式「・I・I・I又 は『に相当する異なる単位を含有する特許請求の範囲第7項~第10項のいずれかに記載 のコピー組成物
- 12. 支持体及び、主成分として
- a) 化学線の作用下で酸を形成する化合物及び
 - b) その主鎖中に繰返しアセタール 又はケ タール部分を有し、現像液中でのその溶解度 が酸の作用によつて上昇する有機重合化合

を含有するレコーディング層とからなる輻射 線感受性レコーディング物質を、現像液中で の層の溶解度が上昇する程度に、化学線に像 に合せて解光し、次いで層の照射部分を現像 液を用いて除去することによりレリーフ像を 形成するに当り、上配成分 b) におけるアセ タール部分又はケタール部分のアルコール成 分の各αー炭素原子が脂肪族である化合物 b)

特別昭53-133429 (3)

を使用することを特徴とするレリーフ像の形成法

3. 発明の詳細な説明

本発明は主成分として a) 化学線の作用下で酸を形成する化合物及び b) 現像液中でのその溶解度が酸の作用によつて上昇する有機重合化合物とを含有する新規輻射線感受性組成物に関する。

ポジチブ作業の感光コピー物質、すなわちそのコピー層が露光域中で可溶性になる物質は公知である。なかんずくの一キノンジアジドをベースとするポジチブ作業のコピー組成物は実際に使用されて来た。

これらのコピー物質の感光度はしばしば不充 分である。感光度は接触作用の感光系を使用することにより増加させることが出来る。それた いりのもこの場合には量子収量が1よりも大大きくなるからである。この様にして光分解により 生成した酸の作用による二次反応の開始及びそれによる露光域の可溶化の公知の原理が最近ボ 更に光化学的酸生成剤とある一定のポリアルデヒド及びポリケトンとの組合せも露光後に可視像を生じさせるポジチブ作業のコピー組成物として提案された(米国特許明細書第3915704号、同第39157483号及び同第3932514号)。

しかしこれらの組成物には次の様な欠点がある。すなわちレコーデイング物質の質を決定する重要な成分としてのポリアルデヒド及びポリケトンは実際の要求に適合させる様にその性質を変化させることが容易に出来ない。

又上記のアセタール及び O.N - アセタールを 含有するコピー組成物の実際の感光度はその接 触作用にもかかわらず十分でない。 その上上記 のアセタール、 O.N - アセダール及び o - エヌ テルの多くのものは取得が容易でない。

本発明の課題は化学線、特に短波光及び電子 ビームに対して高感度を有し又容易に取得出来 る新規のポンチブ作業感光性コピー組成物を提 供することである。

本発明は主成分として a) 化学線の作用下で酸を形成する化合物及び b) その主鎖中に繰返して セタール部分又はケタール部分を有しし、現代中でのその溶解度が酸の作用によっての溶解度が酸の作用によって必要の作用による。本発明によるコピー組成物に関する。本発明によるコピー組成物に関する。本発明によるコピール部分のアルコール成分の各 αー炭素原子が脂肪族であるという特徴を有する。

本明細鸖中で"化学線"という語はそのエネルギーが少なくとも短波可視光線のそれと同様

である輻射線を意味する。 長波紫外線が特に適当であり、又電子ビーム及びレーザービームも ホナス

適当な液体現像剤は特に水溶液、有利には弱アルカリ性水溶液であるが、所望の場合には水 又は水溶液と混合し得る有機溶剤を使用すると とも出来る。

" アルコール成分 " という語は特化、アルコール、有利には多価アルコールから誘導される 重合体の繰返し単位の部分を言う。 しかしこの 語は又、下記に詳述される様に、ヒドロキシア ルキルカルボニル化合物の部分又はそれから誘 導される1個以上のアルコール OH 基を有する 単位をも指す。

本明細番中で使用される意味での"アルコール OH 基"はそれらの中1個だけが飽和脂肪族 炭素原子に結合している蕗のみを指す。そのそれぞれがアセタール基又はケタール基のみの1 個の酸素原子に結合しているα位における炭素 原子にとつて重要なことは飽和脂肪族又はシク

特昭昭53-133429(4)

口脂肪族炭緊原子であるととである。

繰返してセタール及び/又はケタール部分を有する重合化合物の中で、アルデヒド及び/又はケトン(又はその合成等価物)と二価アルコールとを重付加及び/又は重縮合条件下で反応させることにより得られるものが有利であり、下記の一般式!の単位を有する重合化合物が特に有利である:

[式中:nは $1\sim40$ 、有利には $1\sim200$ 0整数を表わし、 R_1 及び R_4 は H 原子、 T ルキル基、有利には炭素原子数が $1\sim120$ もの、又は T リール基を表わし、 R_3 及び R_6 は炭素原子数が少なくとも 2 、有利には $2\sim18$ 、最も有利には $4\sim180$ アルキレンオ

ール基、ハロゲン原子、シアノ基、エステル基 、アリールオキシ基又はアルコキシ基により置 換されていることが出来、又エーテル基又はケ ト基を含有することが出来る有枝又は不有枝、 飽和又は不飽和、環状又は開鎖状のものである

有利なアルキレン基はエステル基、アルコキン基はエステルを、アルコキン基はアリールオキン基で置換されているとが出来るか又はケト基を含有することが出来るかとは不 6 枝又は不有枝の脂肪族基である。 更に炭素鎖の個々の段をヘテロ原子、有利には酸素で置換することが出来る。 いずれの場合にもすべてのアルキレン基の末端 負は飽和脂肪族又はンクロ脂肪族炭素原子であるべきである。

式 I に相当する単位を含有する重合化合物の中での特定グループはアルデヒド: R₁CHO 又はアセタール: R₁CH(OR₇)₂ とジオール:HOR₃OHとを反応させることにより得られる一般式 II:

アリール基は炭素原子数が通常6~20の単核又は多核芳香族又は複素芳香族基であり、これはアルキル基、ハロゲン原子、シアノ基、スルホニル基、アシル基又はカルブアルコキン基で置換されていることが出来る。単核芳香族基、特にフェニル基が有利である。

アルキル基は場合により置換されているアリ

$$\begin{pmatrix}
R_1 \\
I \\
C - OR_3 - O \longrightarrow_m$$

〔上記式中:mは2~80、有利には3~40の整数を表わし、R₁はアルキル基、有利にはを 炭素原子数1~12のもの、又はアリール基 表わし、R₃はアルキレン基、有利には炭素原子数4~18のものを表わし、R₄はアルキル 素、有利には炭素原子数1~8のもの、特には チル基又はエチル基を表わし、その他のをは ナル基、アルキル基及びアルキレン基は上 に定義した意味を有する〕の繰返し単位を含有 する重縮合生成物である。

異なるアルデヒド又はアセタール及び/又は ジオールを使用する場合には式『に相当する異 なる単位が統計的配置で得られる。 この統計的 配置はアセタール形成成分の数及びその原子量 に依存する。アセタールに比べてアルデヒドの

特開昭53-133429(5)

方が取得し易いためにポリアセタール形成成分としてはアルデヒドが有利である。アセタール 製法の一般的説明は例えばホーペン・ワイル(Houben-Weyl)著"メトーデン デル オーガ ニッシェン ケミー(Methoden der organischen Chemie)" 第『/3巻に記述されている。

n - ペンタナール、2 - 及び3 - メチルーペン タナール、2-プロム-3-メチル-プタナー ル、n-ヘキサナール、2-及び3-エチルー プタナール、4-メチルーペンタナール、シク ロベンタンカルプアルデヒド、n-ヘブタナー シクロヘキサンカルプアルデヒド、1,2 .3.6-テトラヒドローペンズアルデヒド、 3-エチルーペンタナール、3-及び4-メチ ルーヘキサナール、 n - オクタナール、 2 - 及 び4 - エチルーヘキサナール、3 . 5 . 5 - ト .リメチルーヘキサナール、4-メチルーヘブタ ナール、3-エチルーn-ヘプタナール、デカ ナール、ジシクロペンタジエンのモノオキソ合 成生成物、ドデカナール、クロトンアルデヒド 、ペンスアルデヒド、2-,3-及び4-プロ ムーベンズアルデヒド、2-,3-及び4-ク ロルーペンズアルデヒド、2,4-ジクロルー 及び3,4-ジクロルーペンスアルデヒド、4 -メトキシーペンズアルデヒド、2.3-ジメ トキシー及び2,4-ジメトキシーペンズアル

デヒド、2-・3-及び4-フルオルーベンズ アルデヒド、2-・3-及び4-メチルーベン ズアルデヒド、4-イソブロビルーベンズアル デヒド、3-及び4-テトラフルオルエトキン ーベンズアルデヒド、1-及び2-ナフトアル デヒド、フルフラール及びチオフエン-2-ア ルデヒド。

適当な二価脂肪族 アルコールは例えば以下のものである: ベンタン・1 ・5 ージオール、 ローベキサン・1 ・6 ージオール、 2 ーエチルーヘキサン・1 ・6 ージオール、 2 ・ ステメー1・7 ージオール、 ンクロヘキサン・1・4 ー ンオール、 アージオール、 3・6 ー ジオール・フーンオール・フーンオール・フーンオール・フーン・フーン・フール・ドデカン・1・12 ー ジオール・ローン・オール・ドデカン・1・12 ー ジオール・ローン・ステル・ローン・ステル・コ・4 ー ビスー(ヒドローン・ステル)ーンクロヘキサン、 2 ー メテル・シ

クロヘキサン-1 ・4 -ジエタノール、2 -メ チルーシクロヘキサンー1.4-ジプロパノー ル、チオージプロピレングリコール、3-メチ ルーペンタン-1.5 -ジオ-ル、ジプチレン - グリコール、オキシピバリン酸 - ネオペンチ ルクリコールエステル、4.8 - ヒスー(ヒド ロキシメチル)-トリンクロデカン、n-プテ ソー(2)-1,4-ジオール、n-ブト-2 - インー1,4-ジオール、n-ヘキス-3-イン-2.5-ジオ-ル、1.4-ピス-(2 - ヒドロキシエトキシ) - プチン - (2)、 p - キシリレングリコール、2.5 - シメチルー ヘキスー3-イン-2,5-ジオール。ビス-(2-ヒドロキシエチル) - スルフアイド、2 , 2 , 4 , 4 - テトラメチルシクロプタン-1 ,3-ジオール、ジー,トリー,テトラー,ベ ンター及びヘキサエチレングリコール、ジー及 びトリプロピレングリコール及び平 均分子 最が 200.300,400及び600のポリエチ レングリコール。

一般式 J に相当する単位を含有する重合化合物の更に別の特定グループはケタール:

「式中: R₁ ・R₂ 及び R₃ は上記のものを表わし、 m は 2 ~ 8 0、有利には 3 ~ 4 0 の整数を表わす〕に相当する繰返し単位を有する重縮合生成物である。

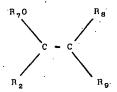
R、及びR。はその他に置換されていてもよ

特別昭53-133429 (6) 大通環の一部である。アリール をも出来る。アリール をも出来る。アリール をも出来る。アリール をも出来る。 アルキル 基及びアルキレン基は式 して定義されているものである。 異なるだけ のである。 場合には のである。 ののが、 ののが、 ののが、 ののが、 ののが、 ののが、 ののが、 ののが、 のののが、 ののののである。 との原子量に ののである。 との原子量に ののである。 との原子量に ののである。 との原子量に ののである。 とのでする。 といて ののである。 といて ののである。 のである。 でのである。 のである。 のでる。 のでる。 のでる。 のでる。

ケタールは例えば以下のケトンから誘導する ことが出来る:フェニルアセトン、1,3ージ フェニルーアセトン、2,2ージフェニルーア セトン、クロルー及びプロムアセトン、ペンジ ルアセトン、ブタンー2ーオン、ペンジループ ロピルケトン、エチルペンジルケトン、ペンジ ルメチルケトン、5ーメチルーへキサンー2ー オン、2ーメチルーペンタンー2ーオン、2ー メチルーペンタン-3ーオン、ヘキサン-2ー

オン、ヘキサンー3ーオン、ペンタンー3ーオ ン、2-メチループタン-3-オン、2,2-ジメチループタン・3ーオン、5ーメチルーへ ブタン・3-オン、オクタン-3-オン、オク タン・4 - オン、オクタン・2 - オン、ノナン - 2 - オン、ノナン:- 3 - オン、ノナン - 5 -. オン、ヘブタン-2-オン、ヘブタン-3-ォ ン、ヘブタン・4ーオン、ウンデカン・5ーオ ン、ウンデカンー6-オン、ドデカン-2-オ ン、ドデカン-3-オン、ジノニル-ケトン、 ウンデカン-4-オン、ウンデカン-2-オン 、トリデカン-2-オン、トリデカン-3-ォ ン、ドデカン・5~オン、ジオクチルケトン、 2 - メチルーオクタン - 3 - オン、シクロプロ ピルメチルケトン、デカン-2-オン、デカン - 3 - オン、デカン - 4 - オン、メチル - α -ナフチルーケトン、ジデシルケトン、ジヘブチ ルケトン、シヘキシルケトン、3-フルオル-4 - メトキシーアセトフエノン、アセトフエノ ン、4-クロルーアセトフエノン、2,5-ジ

クロルーアセトフエノン、4-プロムーアセト フェノン、2.4 ージメチルーアセトフェノン 、2-,3-及び4-フルオルアセトフェノン 、デソキシベンソイン、2-,3-及び4-メ トキシーアセトフエノン、2~,3~及び4~ メチルーアセトフエノン、プロピオフエノン、 2 - プロムープロピオフエノン、4 - フルオル - プロピオフエノン、 4 - メトキシープロピオ フエノン、プチロフエノン、4-クロループチ ロフェノン、パレロフエノン、ペンソフェノン 、 4 - クロルーペンソフエノン、 4 。 4' - ジク ロルーペンゾフエノン、2,5 - ジメチルーペ ンソフエノン、3,4-ジメチルーベンゾフェ ノン、2-及び4-フルオルーペンソフェノン 、4~メドキシ・ベンゾフェノン、シクロヘキ サノン、2-フェニルーシクロヘキサノン、2 - , 3 - 及び 4 - メチル - シクロヘキサノン、 2.6-ジメチルーシクロヘキサノン、4-1 - プチルーシクロヘキサノン及び2~クロルー シクロヘキサノン。

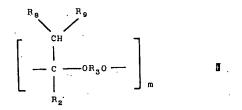


「式中:R2 はH原子、アルキル基、有利には 炭素原子数1~12のもの、又はアリール基を 表わし、Rn はアルキル基、有利には炭素原子 数1~6のもの、特にメチル基又はエチル基を 表わし、Re 及びRo はH原子又はアルキルを 又はアリール基を表わし、その場合有利には両 基合計の炭素原子数が11より多くあるでも はない〕のエノールエーテルとを反応させることにより得られる一般式 ■:

している少なくとも1個の水素原子を有するアルデヒドであり、又R2 がH原子以外のもな対し、又R2 がH原子以外のをで対した力・ルエーテルはカルボニルをに対くとも1個の水器原子に結合している少な、上記した様にエノールエーテルは相当するカルボニル化合物の代りに出発物質価物は例えばアルキンが出来る。更に別の合成等価物は例えばアルキンである。

適当なエノールエーテルは上記したアルデヒド及びケトンに上記の条件付きで相当するエノールエーテルである。その製法は例えばホーベンーワイル(Houben-Weyl)第 VI / 3 巻及び"リービッヒス アナレン デル ケミー(Liebigs Annelen der Chemie) " 1956年第81巻601頁に配述されている。

適当なジオールは例えば式『及び『aに関連 して挙げられているものである。



「式中:R2、R3、R8 及びR。 は上配のものを表わし、mは2~80、有利には3~40の整数を表わす〕の繰返1単位を含有する重かの整数を表わす〕の繰返1単位を含有する重かである。上記式中でR2 とRの、又はR8 とR。 はR8 とR8 とR9 はR8 とR8 とともしたまい共通環に属することもレンる。出ていてもよい共通環に属することをは発るには、プリール基、アルキル基及びアルキレンる。は、アリール基、アルキル及びアルキレンる。は、カールを表されているものには、式」で表わされる異なる単位が統計的配置で得られる。

R₂ が H 原子を表わすエノールエーテルはカ ルボニル基に対して a 位の飽和炭素原子に結合

繰返しアセタール基又はケタール基を有する 重合化合物の更に別のグループはジェノールエーテルにジオールを付加することにより得られる付加生成物である。

有利には式』に関連して挙げられているジオ - ルが使用される。

適当なジェノールエーテルは例えばアセチレンにジオールを付加することにより得られるジビニルエーテルである。その様な化合物は例えば"リービンヒス アナレン デル ケミー(Liebigs Annalen der Chemie)"1956年第81巻601頁に記述されている。有利なジビニルエーテルの例としては以下の化合物が挙げられる:エチレングリコール、プタンー1・4ージオールー及びヘキサンー1・6ージオールージビニルエーテル、及びポリアルキレングリコールのジビニルエーテルが特に有利である。

一般式 | に相当する単位を有する重合化合物の更に別のグループはヒトロキシアルキルーエ

特昭昭53-133429(8)

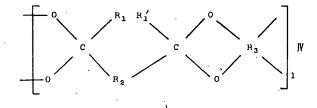
ノールエーテルの重付加により製造される一般 式 II に相当する繰返し単位を有する反応生成物 である。 これら出発物質は同じ分子中にカルボ ニル等価物とアルコール成分とを含有する。 こ の場合には R₃ が R₈ 又は R₉ と結合して場合 により 置換されている環を形成することも可能 である。

異なるヒドロキンアルキルエノールエーテルを使用する場合には、重付加反応によつて式II に相当する異なる単位の統計的連続生成物が生成する。

適当なヒドロキシアルキルエノールエーテルは例えば、"リービッヒス アナレン デルケミー(Liebigs Annalen der Chemie)"
1956年第81巻601頁に記述されている。これは アルキン、有利にはアセチレンにジオールを付加することにより製造される。その様な化合物の適当な代表は例えば、ジェチレングリコールモノビニルエーテル及びトリエチレングリコールモノビニルエーテルである。

上記のヒドロキシアルキルビニルエーテルは
又、アルキレンジエノールエーテルに1・2ー
又は1・3・ジオール1 モルを付加し、引続い
て分子内再アセタール化を行い、その間には1・3・ジオキソランとは1・3・ジオキソランとも出来る。
ないで酸性条件下でヒドロキシアルキルーエを形成かる。同時に、生成した1・3・ジオキカシスを単離する。

一般式 | に相当する繰返し単位を有する重合化合物の更に別のグループはジアルデヒド又はジケトン又はその合成等価物と4価のアルコールとの重縮合により製造される、一般式 IV:



適当なジアルデヒド又はジケトン、又は合成 等価物がそれから誘導されるジアルデヒド又は ジケトンは例えば、マロンジアルデヒド、シク ロヘキサー1・4 - ジオン又はアジピンジアル デヒドである。

適当な4価アルコールは例えば、2,2,5 ,5 - テトラメチロールーンクロベンタノン及び2,2,6,6 - テトラメチロールーンクロヘキサノンである。

上記の有利な重合体は容易に取得し得るアルデヒドとジオールとの重縮合により容易に、速やかに又非常に安価に得ることが出来る。アルデヒドの代りに相当するアセタール又はエノールエーテル、又はケトン又はそのケタール又は相当するエノールエーテルを使用することも出来る。

それはつまり実際上いずれのタイプのポリア セタール又はポリケタールもアルデヒト及びケ トン又はその合成等価物とジオールとの重付加 又は重縮合により製造出来ることを意味する。

特開昭53-133429(9)

その上例えば西ドイツ国特許公開公報第251 9575号に記載の方法と同様にして、例えば 高められた温度において更に再アセタール化を 行うことにより、重合度を広範囲内で変化させ ることが可能である。

更に末端 OH 基を、 OH 基と反応可能の多官能性化合物例をはジインシアネート又はジェボキットと反応させることにより公知の仕方でポリアセタール又はポリケタールの分子量を増すことが出来る。

又使用される小量のジオールの代りにトリオールの代とによりにような一ルのの分子 構造を 重ったの分子 に しさせる ことが出来る かれを生ま ないに からない はいか と 大 の間の を 所 望の を 解度 との 間の 差異 を 所 望の を 解度 といけ が と な な な な で の コーティング 溶液を 調製 し 得る な か な ければ な らな い。 適当な ト リオールは 例

えばグリセロール、1,2,6-ヘキサントリオール、トリメチロールブロバン、1,4,7 -トリヒドロキシーヘブタン及びそれらと酸化エチレンとの反応生成物である。

上記のアルデヒド及びケトン及び、それからその合成等価物が誘導されるアルデヒド及びケトン、及び多価アルコールは重付加又は重縮合の間困難を惹起させる様な置換分を含有するべきではない。

上記のアルデヒド又はケトン又はその合成等価物とジオールとの共重付加及び/又は重縮合により統計的構造を生じさせる他に、一般式 1 に相当する繰返し単位を有する重合化合物に計画した構造を付与することも可能である。

これも種々の方法で達成することが出来る。例えばジアルデヒド又はジケトン、又はその合成等価物と4価アルコールとの上配の重縮合により得られる種々の"対称"物質の他に、種々の"非対称"物質も可能である。その様にして例えばフセチレン2モルにジオール1モルを付

加することにより得られるジピニルエーテルを ジオールと例えば重付加することにより一般式 」に相当する繰返し単位を有する重合化合物を 製造することが出来る。

一般式 | の繰返し単位を有する重合化合物は常にアルデヒド又はケトン、又はその複合物又は等価物とジオール又はジオールの相当する複合物とから誘導され得ることがその特遣により明らかである。

一般式!に相当する繰返し単位を有する重合化合物がアルデヒド及び/又はケトン、又はその合成等価物とシオールとの重付加及び/又は 重縮合条件下での反応により得られるという記述はこのより広い意味で理解されるべきである

本明細掛中に詳述されている製法は式」に相当する繰返し単位を有する重合化合物を製造するための実際に容易に実施出来る方法である。 その他の方法については全般的に例えばホーベン-ワイル(Houben-Weyl)第14/2巻に包 含されている。

本発明によるポジチブ作業のコピー組成物を製造するためには、上記のポリアセタール及び/又はポリケタールを光化学作用下で及び/又は高エネルギー輻射、特に電子ピームの作用により酸を形成し得る物質と混合する。

有利にコピー組成物はその他に、有根溶剤中に溶解し有利には水に溶けない重合体結合剤を含有する。本発明によるコピー組成物用の現像液としてアルカリ性水溶液を有利に使用することが出来又このタイプの現像液は一般に有機溶がに基づく現像液よりも有利であるから、アルカリ性水溶液中に溶解し得るか又は少なくとも膨調し得る結合剤が有利である。

多くのポジチプコピー組成物用に適当である ことが見出されているフエノール樹脂、特にノ ボラックが本発明によるコピー組成物用にも非 常に適当で有利であることが立証された。これ らの結合剤、特にホルムアルデヒド縮合成分と して置換フェノール、例えばクレゾールを含有

特別 昭53-133429(10)

するより高度に縮合した樹脂は現像の間層の露 光域と未駕光域との間の差を大きくするために 寄与する。ノボラックは公知法で、そのヒドロ キシル基の部分を例えばクロル酢酸、イソシア ネート、エポキシト又は無水カルポン酸と反応 させることにより改質することが出来る。別の アルカリ可溶樹脂、例えば無水マレイン酸とス チレンとの共重合体又は酢酸ビニルとクロトン 酸との共重合体又はメタクリル酸メチルとメタ クリル酸との共重合体等も結合剤として使用す ることが出来る。アルカリ可密樹脂のタイプ及 び畳は組成物の使用目的によつて変えることが 出来る。固体分含量30~90重量%、有利に は55~85重量%の割合が有利である。その 他に種々の他の樹脂を付加的に合体させること が出来、それらとしてはピニル重合体、例えば ポリ酢酸ピニル、ポリアクリレート、ポリビニ ルエーテル及びポリビニルピロリドン一とれら は又コモノマーにより改質することが出来る一 が有利である。その様な樹脂の最も有利な含有

<u>--</u>

割合は各場合の実際の要求性及び現像条件に及ぼす影響に依存して定められる。通常アルカリ可溶樹脂に対して20重量を整えない。柔軟性、接着性、光沢等に関して特別の要求がある場合には、別の物質例をばポリグリコール、セルロース誘導体例をばエチルセルロース、湿潤剤、染料及び微粉状顔料を小量感光組成物に添加することが出来る。

非常に様々な公知化合物及び混合物例えばジアゾニウム塩、ホスホニウム塩、スルホニウム塩及びヨードニウム塩又はハロゲン化合物、キノンジアジドスルホクロリド及び有機金属/有機ハロゲン化合物も輻射の間酸を形成又は分離する輻射線感受性成分として使用することが出来る。

適当なジアゾニウム塩は、ジアゾタイプ目的 用に適当であることが知られている、有用な吸収範囲300~600mmを有する化合物である。十分な貯蔵寿命を有することが知られている多くの適当なジアゾニウム化合物が実施例中に

挙げられている。塩基性置換分を有さない化合物が有利である。

通例上記のジアゾニウムー、ホスホニウムー、スルホニウムー及びヨードニウム化合物は有機溶剤に可溶の塩の形で、通常錯酸例えば硼弗化水素酸。ヘキサフルオ燐酸、ヘキサフルオアンチモン酸又はヘキサフルオ砒酸との分離生成物として使用される。

又はポッチブ作業の。・キノンジアジドの誘導体を使用することも出来る。大抵の場合。・ナフトキノンジアジドを解光することにより生成するインデンカルボン酸の作用は像に応じた申分のない差異をつくるために辛うじて十分である。このグレーブの化合物の中ナフトキノン有利である。それというのもその露光の間3個の酸がポリケタールの分離の間比較的高度の増感を惹起させるからである。

原理的には遊離基形成性感光開始剤として知

更にある一定の置換トリクロルメチルピロン、例をば西ドイツ国特許公開公報第2610842号に記述されているものを使用することも出来る。同一出顧人の同日付け特許顧(I)に記載の新規2-アリールー4・6-ビスートリクロルメチルーs-トリアシンが実際的に有利であることが見出された。

適当な開始剤の例は次の様である:

4 - (ジーn - プロピルーアミノ) - ベンゼン- ジアゾニウムーテトラフルオ硼酸塩、

4-p-トリルメルカプト-2・5-ジェトキ シーペンゼン-ジアゾニウム-ヘキサフルオ燐 酸塩、

4 - p - トリルメルカプト - 2 , 5 - ジェトキ シーペンゼンージアゾニウム - テトラフルオ硼 酸塩、

ジフェニルアミン-4 -ジアゾニウム硫酸塩、 4 -メチル-8 -トリクロルメチル-2 -ピロン

4-(3,4.5-トリメトキシースチリル)
-6-トリクロルメチル-2-ピロン、
4-(4-メトキシースチリル)-6-(3.

4 - (4 - メトキシーステリル) - 0 - (3, 3 - トリクロループロベニル) - 2 - ピロン、

2 - トリクロルメチルーベンズイミダゾール、 2 - トリプロムメチルーキノリン、

2,4-ジメチルー1ートリプロムアセチルー

ベンゼン、

3-=トロー1-トリプロムアセチルーベンゼ ン

4ージプロムアセチルー安息香酸、

1 . 4 - ビスージプロムメチルーベンゼン、 トリスージプロムメチルー s ートリアジン、

2-(8-メトキシーナフト-2-イル)-、

2-(ナフト-1-イル)-、

2-(ナプト-2-1ル)-、

2-(ベンソビラン-3-1ル)-、

2 - (4 - メトキシーアントラス - 1 - 1 ル) -.

及び

2 - (フェナントル - 9 - イル) - 4 , 6 - ビ スートリクロルメチル - s - トリアジン 及び実施例中に挙げられている化合物。

開始剤の量はその化学的性質及び層の組成に 依つて広範囲に変えることが出来る。固体分の

全重量に対して約0.1~約10重量多の範囲の量で良い結果が得られ、0.2~5重量多の量が有利である。特に10μmより厚い層の場合には酸供与体を比較的小量だけ層に添加することが推められる。

更に可容性又は微粉状分散染料を感光組成物に添加することも出来、又使用目的にとつて必要であるならば紫外線吸収剤を添加することも出来る。層中に含有される種々の成分の最も有利な量は予備テストにより容易に決定するととが出来る。

本発明による組成物用の適当な溶剤はケトン 例えばメチルエチルケトン、塩素化炭化水素例 えばトリクロルーエチレン及び1・1・1・ト リクロルーエタン、アルコール例えばロープロ パノール、エーテル例えばテトラヒドロフラン 、アルコールエーテル例えばエチレングリコー ルモノメチルエーテル、及びエステル例えば酢 酸プチルである。これらの溶剤の混合物も使用 することが出来、又他の溶剤例えばアセトニト リル、シオキサン又はシメチルホルムアミドも 特別な目的のためには添加することが出来る。 原理的には層の成分と不可逆反応を行わないあ らゆる密剤が適当である。

特朗昭53-133129(12)

他の公知のポッチブ作業の層、特に 0 - ナフトキノンジアッドを含有するものに比べて、本発明による感光組成物を用いる場合には比較的厚い層を製造する上により大きな利点が得られる。それというのも本発明による感光組成物の感光度は層厚への依存性が少ないからである。100μm 以上の厚さの層を露光及び処理するとが可能である。

更に鍋層を有する絶縁板からなる配線板材の 片面又は両面に、又は接着促進剤で前処理され ていることが出来るガラス又はケラミック材に 、又はミクロエレクトロニクスにおいて電子ビ -ムによる潜像形成をするために適することが

見出されたシリコンのスライスに同コーテイングを直接に又は転写支持体からの転写法により適用することが出来る。その他木材製品、繊維製品、及び投影により有利に潜像形成が行われてルカリ性現像剤に対して耐浸蝕性を有する多くの物質の装面にコートすることが可能である

コート層を乾燥するためには常用の装置及び 条件を使用することが出来、約100℃の温度 及び120℃への短時間の加熱にすら同盗膜は その輻射線感受性を滅ずることなく耐えられる

本発明による物質を露光するためには、コピー用に常用される光源、すなわち管形電球、パルス式キセノン光源、ハロゲン化金属配合高圧水銀蒸気灯及び炭素弧光灯も使用することが出来る。その他感光性ポリアセタール及び/又はポリケタール層を常用の投影及び引伸し装置中で金属フィラメント灯の光に露光することも出来るし、又は常用の白熱電球の下で接触観光す

ることも出来る。更に干渉レーザービームを餌光用に使用することも出来る。本発明の目的のためには十分なエネルギーの短波レーザー、例をは300~600nmを放射するアルゴンレーザー、 や料レーザー及びへ リウムーカドミウムレーザーが適けであることが見出された。レーザーとは、所与のプログラムによる線及び/又はスクリン運動により当てられる。

特開昭53-133429(13)

常のセフトキノンジアジト層よりも電子ビームに対してずつと敏感であること及び実施例に記述されている様に比較的低エネルギー効率の広範囲の電子ビームを使用し得ることが見出された。最も有利な条件は予備テストにより容易に確めることが出来る。

 焼付け作業の間の物理的強度及び洗い出し溶液、修正剤及び紫外線硬化性印刷インギに対する耐性を増すために、シアソ層に対して公知であり又例えば英国特許明細審第1154749 号に記述されている様に、現像されたブレートを比較的高温で短時間加熱することが出来る。

つて補助することが出来る。

本発明は又レリーフ像を形成するための方法にも関し、該方法は主成分として

a) 化学線の作用下で酸を生成する化合物及びb) その主鎖中に繰返しアセタールー又はケタ

- ル部分を有し、現像液中でのその溶解度が

酸の作用によつて上昇する有機重合化合物を含有する輻射線感受性レコーディング物質を現像液中への層の溶解度が増加する程度に化学線に像に合せて露光し、次いで層の照射部分を現像液を用いて除去することからなる。本方法はアセタールー又はケタール部分のアルコール成分の各αー炭素原子が脂肪族である化合物D)を使用することを特徴とする。

本方法を実施するために電子というでは、可視光線では、可視光線では近紫外線の光分解を有する公の解析の解析を有する公のの解析のの解析を有する公のの解析の他に、その吸収を範囲が電磁スペクトルにをを範囲が、、では、大力の対象をでは、ないのが、ないのでは、ないのが、ないのが、ないのが、ないのが、ないのが、ないのが、ないのが、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのではないでは、ないではないでは、ないではないでは、ないではないではないでは、ないではないでは、ないではないではないでは、ない

その様な開始剤の例は例えば、トリプロムメチルーフェニルスルホン、2,2',4,4',6,6'ーヘキサプロムーシフェニルアミン、ペンタプロムエタン、2,3,4,5ーテトラークロルアニリン、ペンタエリトリトールーテトラプロマイド、クロフェンー樹脂w、すなわち塩架化テルフェニル樹脂、又は塩素化パラフインである。

以下に本発明によるコピー組成物の例を記述する。先ず、酸により分離され得る物質として

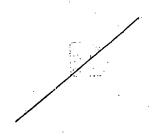
本発明によるコピー組成物中に使用するために 適当であることが見出された一連の新規ポリア セタール及びポリケタールの製造について記述 する。それらは化合物 1 ~ 1 0 6 の番号を付さ れ、その番号で例中に記述される。

例中で重量部と容量部との比率は \$ と ml との 比率である。「 f j 及び「部」は他に記載のな い限り重量による。第1表に記載の化合物 K l ~46を製造するための一般指示 A

てヒドロキシル帯又はカルボニル帯を示さない。 1 の核磁気スペクトル中では第1次に記載されてい いるアセタールプロトンの特性ングナルが見出 される。

反応水を直接蒸留除去した場合にも上記の化合物が得られる。この場合には溶剤なしに作業すること(一般指示 B)又は高沸点不活性溶剤例えば。-ジクロルベンセンを使用することが可能である。又は溶剤が使用されず、反応温度が低い場合には、減圧下で反応水を除去することも可能である(一般指示 C)。

第1表:一般式『に相当する化合物



化合物 MG	R ₁	ħ ₃	核磁気共鳴 アセタール ブロトン ð (ppm) (CDC ℓ 3)	
1	1ソプロピル	-(CH ₂) ₂ -0-(CH ₂) ₂ -	4.15	52
2	n ーヘキンル	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₂ -	4.56	78
· . 3	n -~キンル	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₃ -	4.54	73
. 4	1ソプロピル	-(сн ⁵) ⁵ -(осн ⁵ сн ⁵) ⁵ -	4.18	74
5	1ソプロピル	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₃ -	4.17	66
. 6	インプロビル	p~キシリレン	4.35	46
7	n-プロピル	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₂ -	4.60	5 2
8	1-エチループロピル	-(CH ²) ² -(OCH ² CH ²) ² -	4.41	4.5
9	1-エチルーペンチル	-(CH2)2-(OCH2CH2)2-	4.48	66
10	フェニル	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₂ -	5.62	47
. 11	シクロヘキンル	-(CH2)2-(OCH2CH2)2-	4.22	60
12	エチル	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₂ -	4.50	71
13	n - プチル	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₂ -	4.57	80
14	イソプロピル	-(CH ₂) ₅ -	4.07	87
15	3-シクロヘキセン-1-イル	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₂ -	4.35	74
,16	1-エチループロビル	p - キシリレン	4.55	47
17	1/プロピル	-(CH ₂) ₂ -S-(CH ₂) ₂ -	4.15	67

	l i		ı	i
18	フエニル	p-キシリレン	5.71	78
19	フエニル	-(CH ₂) ₅ -	5.45	- 66
20	エチル	1,4-シケロヘキ・ハン	4.48	73
21	エチル	1-エチルーヘプチレン	4.37	. 88
22	n -ウンデンル	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₂ -	4.57	89
23	エチル	1,4-ジメチル-シクロヘキサン- 7,8-イレン	4.34	9:
24	エチル	-(CH ₂) ₂ -O-CH ₂ -C≡C-CH ₂ - O-(CH ₂) ₂ -	4.56	6 1
25	2,4-ジクロルーフエニル	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₂ -	6.11	70
26	エチル	*)	4.37	9 ;
27	n -ペンチル	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₂ -	4.60	70
28	n-ノニル	-(CH ₂) ₂ -(CCH ₂ CH ₂) ₂ -	4.57	7:
29	エチル	-(CH ₂) ₃ -(OCH ₂ CH ₂ CH ₂) ₂ -	4.50	4:
30	エチル	p - キシリレン	4.65	. 6
31	2-7エニル-エ チ ル	p - キンリレン	4.70	41
32	2-フエニルーエチル	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₂ -	4.60	8
33	エチル	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₄ -	4.51	5
34	エチル	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₆ -	4.50	6.
35	エチル	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₃ -	4.51	5
			1	ļ ,

36	トリンクロ - (4,3,1,0) - デシル	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₂ -	4.33	87
37	(CH ₃) ₂ CH-CH ₂ -0-CH ₂ -C (CH ₃) ₂ -	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₂ -	4.35	64
38	4 -クロル-フエニル	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₂ -	5.74	66
39	3-クロル-フエニル	-(CH ₂) ₅ -	5.48	. 83
40	3-クロル-フエニル	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₂ -	5.61	ВІ
41	4-1ソプロビル-フエニル	-(CH ₂) ₅ -	5.45	6.3
42	1-ブロペニル	-(CH ₂) ₅ -	4.65	4.1
43	エチル	-(CH ₂) ₅ -	4.48	75
44	トリンクロー (4,3,1,0) - デシル	-(CH ₂) ₅ -	4.21	4.3
45	エチル	-(CH ₂) ₆ -	4.39	46 .
46	イソプロピル	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₈ -	4.35	79
	'	1		I

*) 4,8-ジメチルートリンクロー(4,3,1,0)ーデカンー 11,12-イレン

第2表に記載の化合物紙47~63を製造す

るための一般指示B

フセタール又はケタール及びジオールを約

1:1のモル比で、酸触媒例えばメンチレン

特昭四53-133429(15)

第2表:一般式 Daに相当する化合物

スルホン酸 1~2 重量 5 の存在下で、反応の間に形成された低沸点アルコールが完全に 5 留除去されるまで加熱する。不活性 8 削及び 固体体の炭酸ナトリウムを 添加した後で反応 混合物を 2 適して 密剤を分離する。 100~150℃に 5 いて高真空下で揮発性成分を除去した 後で 20 間した高 1 性の 1 世 1 世 2 ル帯を示さない。

同化合物は又低温度において減圧下でか(一般指示で)又は比較的高温において高沸点不活性務剤例をば。一ジクロルベンゼンの存在下で低沸点アルコールを除去することによつても得ることが出来る。



•				
化含物	· R ₁ .	R ₂	. R ₃	収 半 (理論値)C対する %)
47	フエニル	-н -	-(CH ₂) ₅ -	80
48	トリクロルメチル	н –	-(CH2)2-(OCH2CH2)2-	40.
49	1-エチルーペチル	н -	-(CH ₂) ₅ -	55
50	4-メトキシーフエニル	н -	-(CH ₂) ₅ -	68
51	フエニル	メチル	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₂ -	78
52	フエニル	フエニル	-(CH ₂) ₅ -	80
53	-(CH ₂) ₅ -		-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₂ -	78
54	メチル	p-トリル	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₂ -	, 75
55	メチル	エチル	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₂ -	79
56	n - ノニル	n-ノニル	-(CH ₂) ₅ -	75
57	メチル	α-ナフチル	-(CH ₂) ₅ -	92
58	フエニル	エチル	*)	75
59	エチル	エチル・	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₃ -	81
60	メチル	n-~>+n	-(CH ₂)' ₅ -	61
61	イソプロビル	メチル	-(CH ₂) ₆ -	60
		1	I	l

	•	t I	t .	
62	フエニル	n-トデンル	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₃ -	92
63	n-ノニル	メチル	p-キシリレン	76

*) 1,4-ジメチルーシクロヘキサン-7,8-イレン

第3表に記載の化合物 M 64~83を製造するための一般指示 C

上記の化合物は又溶剤の使用なした(一般 指示B)又は高沸点不活性溶剤例えば。一ジ クロルベンゼンの存在下で低沸点アルコール を直接蒸留除去することによつても得られる

第3段:一般式電に相当する化合物

化含物 /K.	R ₂	R ₈	Rg	R ₃	収 ※ (理論値 バ対す るる)
64	n -プロビル	エチル	н-	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₂ -	70
65	n - プロピル	エチル	н-	p ーキンリレン	76
66	n-プロビル	エチル	н-	-(CH ₂) ₂ -0 -(CH ₂) ₂ -	88
67	n-プロビル	エチル	н-	-(CH ₂) ₅ -	91
68	n-プロビル	エチル	н-	1、4-ジメチル-シクロへキサン- 7、8-イレン	84
69	n-プロピル	エチル	н-	*)	-96
70	メチル	フェニル	н-	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₂ -	8.5
71	н-	メチル	フェニル	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₂ -	80
72	-(сн	2)4-	н-	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₂ -	61

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ı
73	-(CH ₂) ₄ -	н-	p~キンリレン	78
74	~(CH ₂) ₄ -	· H=	1,4-ジメチル-ンクロヘキサン- 7,8-1レン	87
75	-(CH ₂) ₄ -	н-	*)	98
76	-(CH ₂)4-	н-	-(CH ₂) ₅ -	78
77	-(CH ₂) ₄ -	н-	-(CH ₂) ₂ -0-(CH ₂) ₂ -	62
78	-(CH ₂) ₄ -	メチル	-(СН ₂)2-(ОСН2СН2)2-	75
79	-(CH ₂)3CH(CH3)-	メチル	p-キンリレン	63
80	-(сн ₂) ₂ сн(сн ₃)сн ₂ -	н-	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₂	63
81	-(сн ₂) ₃ -сн(сн ₃)-	н-	1,4~ジメチルーシクロヘキサンー 7,8-1レン	94
82	2 - 第三 - ブチル- プチレン	н-	*)	72
83	-(CH ₂) ₄ -	フエニル	-(сн ₂) ₂ -(осн ₂ сн ₂) ₂	84

*) 4,8-ジメチルートリンクロー(4,3,1,0) -デカンー11,12-イレン

化合物 168 4 ~ 9 3

第4 表に記載の化合物 系 8 4 ~ 9 3 を製造 するためには一般指示 A ~ C のいずれかを適 用する。との化合物は組合物である。式 1 に

- 化合物 M 9 0: 2 ー メトキシーンクロヘキセ ンとトリエチレングリコール及びペンタンー 1,5 ー シオール
- 化合物 M 9 1: 2 メトキシーシクロヘギセン及び 4 メトキシーヘブト-3 エンとローキシリレングリコール
- 化合物 K 9 2 : ペンズアルデヒドージェチル アセタール及び 2 ーメトキシーシクロヘキセ ンとトリエチレングリコール
- 化合物 M 9 3: エナントアルデヒド及びベン メアルデヒドージェチルアセタールとトリエ チレングリコール

特別取53-133429(16) より表わされ、カルボニル成分又はその等価 物とジオール成分とから製造される茶が検射 的配優で存在する。反応体として使用した化 合物は以下の様である:

- 化合物 M 8 4: ペンメアルデヒド及び2 -エチループチルアルデヒドとペンタンー 1, 5 - ジォール
- 化合物 版 8 5: イソプチルアルデヒドとペンタン 1,5 ジオール 及び ジエチレン クリコール

化合物	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	Ř ₆	収率 (理論値/C 対する%)
84	フエニル	н-	-(CH ₂) ₅ -0-	1 -エチル-プロビル	н-	-(CH ₂) ₅ -0-	68
85	н-	イソプロビル	-(CH ₂) ₅ -0-	н-	イソプロピレ	-(CH2CH2O)2-	70
86	н-	1 - エチループロビル	-(CH ₂) ₅ -0-	フエニル	н-	-(CH ₂ CH ₂ O) ₃ -	53
	フェニル		-(CH ₂ CH ₂ O) ₃ -	н-	1 -エチループロビル	-(CH2CH2O)3-	4.8
88	フエニル	н-	-(CH ₂) ₅ -O-	1-エチルーベンチル	н-	-(CH ₂) ₅ -0-	73
89	-(0	CH ₂) ₅ -	-(CH ₂ CH ₂ O) ₃	p-メトキンフエニル	н-	-(сн ₂ сн ₂ о) ₃ -	81
90	ł	сн ₂) ₅ -	-(сн ₂ сн ₂ о) ₃	-(CH ₂) ₅ -		-(CH ₂) ₅ -0-	84
91	ì	сн ₂) ₅ -	p -キンリレンオキシ	n-プロピル	n-プロビル	p-キンリレンオキシ	51
92		сн ₂) ₅ -	-(CH ₂ CH ₂ O) ₃ -	н-	フエニル	-(CH ₂ CH ₂ O) ₃ -	80
93	н-	フエニル	-(CH ₂ CH ₂ O) ₃ -	nーヘキンル .	н-	-(CH ₂ CH ₂ O) ₃ -	4.8

第4表:一般式1に相当する化合物

第5表に記載の化合物 M94~102を製造 するための一般指示 D

第5 表:式1 に相当する化合物

化合物	R ₁ =R ₄	R ₂ =R ₅	R ₃	R ₆	核磁気共鳴 アセタール ブロトン	収率 (理論値に 対する%)
94	СН ₃ -	н-	-(CH ₂) ₂ -0-(CH ₂) ₂ -	-(CH ₂) ₂ -0-(CH ₂) ₂ -	4.79	60
95	СН ₃ -	н-	(CH ₂) ₂ -0-(CH ₂) ₂ -	-(CH ₂)4-	4.78	4.9
. 96	сн ₃ -	н-	-(CH ₂) ₂ -0-(CH ₂) ₂ -	-(CH ₂) ₅ -	4.74	61
97	Сн3-	н-	-(CH ₂) ₂ -0-(CH ₂) ₂ -	-(CH ₂) ₂ (OCH ₂ CH ₂) ₂ -	4.79	71
98	сн3-	н-	p-キシリレン	-(CH ₂) ₂ -O-(CH ₂) ₂ -	4.86	68
99	Снз-	н-	1,4-シクロヘキンレン	-(CH ₂) ₂ -0-(CH ₂) ₂ -	4.85	80
100	СН3-	н-	-(CH ₂) ₂ -0-(CH ₂) ₂ -	1,4-ンメチルーシクロヘキサン-7,8-1レン	4.73	62
101	CH3-	н-	-(CH ₂) ₂ -0-(CH ₂) ₂ -	+)	4.70	99
102	СН ₃ -	н-	-(CH ₂) ₄ -	-(CH ₂) ₂ -(OCH ₂ CH ₂) ₂ -	4.75	6.2

+) 4,8-ジメチルートリンクロー (4,3,1,0) -デカンー11,12-1レン

化合物 版 1 0 3

濃硫酸2滴が添加されている塩化メチレン1 0 ml中のプロパンー1,3-- ジォール7.69 の溶 液に、氷で冷却しながら、ジエチレングリコー ルンピニルエーテル15.89を注意深く適加す る。同混合物を室温において2時間攪拌した後 で塩化メチレンを更に40mと固体炭酸ナトリ ウム19を添加する、濾過し、有機相を濃縮す ることにより租生成物が得られ、これはその揮 発性成分の他にアセトアルデヒドートリメチレ ンアセタールを含有する。高真空中で150℃ において低沸点成分を除去した後で粘性油状物 **809が残る。核磁気共鳴スペクトル中で得ら** れたシグナル(1 HNMR(CDC ℓ_{3} , TMS): δ =4.8 2ppm (4 重項、1 アセタールプロトン)、δ= 3.6 8 ppm (単項、12メチレンプロトン)及 びδ=1.34 ppm (二重項、3メチルプロトン)) はジエチレングリコールモノピニルエーテ ル重合体の繰返し単位に相当する。

例えばジエチレンクリコールジピニルエーテ

ルをエチレングリコール、 2,2 - ジェチループロパンー 1,3 - ジォール及び 2 - エチルー2 - プチループロパンー 1,3 - ジォールと反応させることによつても同じ反応生成物が得られる。

化合物 版 1 0 4 ~ 1 0 6

化合物 M 1 0 4 ~ 1 0 6 を製造するためには一般指示 B 又は C を以下のビスーアセタール又はビスーケタール及びテトラー(ヒドロキンアルキル)化合物 に適用する:
化合物 M 1 0 4 : 2,2,5,5ーテトラメチロールーンクロベンタノン及びシクロヘキサンー1,4ーシオンーテトラメチルケタール
化合物 M 1 0 5 : マロンジアルデヒドーテトラメチロールーンクロベンタノン
化合物 M 1 0 6 : アンビンジアルデヒドーテトラエチルアセタール及び 2,2,5,5ーテトラメチロールーシクロベンタノン
化合物 M 1 0 6 : アンビンジアルデヒドーテトラエチルアセタール及び 2,2,5,5ーテトラメチロールーシクロベンタノン

分から起因するカルポニル帯を示す食合体が得 られる。更に別のカルポニル帯又はヒドロキン ル帯はない。

69 1

本実施例は非常に様々なポリアセタール酸供 与体化合物の、ポジチブ作業コピー組成物の成 分としての適当性を示す。

以下の成分:

クレゾールーホルムアルデヒドノボラック(D JN(ドイッ工業規格)53181による毛管 法によつて測定した触点=105~120℃)

4.7 重量部

重合アセタール

1.4 重量部

酸供与体

0.23 重量部

クリスタルヴアイオレツト

0.02 重量部

メチルエチルケトン

9 3.6 5 重量部

からなる溶液をプラツシングされたアルミニウ ムブレート上に12 μm 厚さの層が得られる様 にウアーラー法によりコーテイングする。 同ブ

レートを 5 kW ハロゲン化金属ランプの下で

特昭昭53-133429(19)

110㎝の距離から7.5秒間像に合せて解光 し、次いで下記の現像密液A又はBのいずれ かで現像する:

現像溶液A

メタ珪酸ナトリウム・9 H ₂ O	5. 5 %
三燐酸ナトリウム・12 H ₂ 0	3. 4 %
無水燐酸二水素ナトリウム	0. 4 %
完全に脱塩された水	9 0.7 %

現像溶液B

•				
	NaOH	0	. 6	9
	Na ₂ SiO ₃ ·5H ₂ O	0.	. 5	9
	n ープタノール	1.	0	Æ
	ウ ム w	~	_	_

下記の第6表に酸供与体化合物、使用した 現像液及び現像時間を示す。すべての場合に 原画のポジチブ像が得られ、実際の最高感光 度はテストル4及び低10において見られる

М	化合物	酸供与体	現像液	現像 時間 (秒)
1	5	2,5-ジェトキンー4-(p-トリルーメルカブト)-ベンゼン ジアゾニウムヘキサフルオ類 酸塩	A	20
2	5	1と同様であるが、テトラフルオ研酸塩の形	A	<u>4</u> 5
3	6	ナフトキノン(1,2)ージアジドー(2)ー4 ースルホン酸クロライド	В	10
4	10	2-(4-エトキシーナフト-1-イル)-4, 6-ビスートリクロルメチル-8-トリアジン	A	20
5	13	2,5ージエトキシー4ー(4-エトキシーフエ ニル)ーペンゼン ジアゾニウム ヘキサフルオ 燐酸塩	Α.	20
6	23	2-(3-メトキシナフト-2-イル)-4・6 -ビス-トリクロルメチル-s-トリアシン	В	75
7	96	4-(2,4-ジメトキシースチリル)-6-ト リクロルメチルービルー2-オン	Α	30
8	99 .	後塩業化4ー(4ーメトキシスチリル)ー6ー トリクロルメチルービルー2ーオン	A	10
9	100	後塩累化4ー(3・4ーメチレンジオキシース チリル)-6-トリクロルメチルービルー2-オ ン	A	50
10	43	2ー(4,7ージメトキシーナフトー1ーイル) ー4,6ービスートリクロルメチルーsートリア ジン	A	20

絶縁材(フェノール樹脂積層物)と3 5 μm 厚さの銅箔とからなる混成物体に以下の組成の 耐蝕層を設ける:

例1で使用されたノポラック 39重量部 をエチレングリコールモノエチルエーテル8 2 重量部、酢酸プチル 9 重量部及びキシレン 9 重量部からなる溶剤混合物 7 1 重量部 中に溶かし、

同溶液

8 4. 2 重量部

を化合物 1/64 3

12.1 重量部

2-(4-)1+22+111)-4.6-11スートリクロルメチルーsートリアジン

0.5 重量部

染料 " C.I. ソルヴェント ブルー (Solvent

Blue) 16"

0.8 重量部

及び改質シリコングリコール(市販のコーテ イング補助物質)

2.4 重量部

を密かすために使用し、

同溶液

5 8.5 重量部

特別昭53-133429(20)

重叠部 化合物 16.9

8.89重量部

2-(4-メトキンナフト-1-イル)-4 ,6-ビスートリクロルメチルーsートリア シン 0.12 重量部

例2で使用されたコーティング補助物質

2.08 重量部

をプタンー2ーオン

59.27 重量部

中に密かす。

を再び上記の密剤混合物 4 1.5 重量部 に容かす。

上記視成プレートをこの溶液中に浸し、400m/分の速度で引上げる。同コーテイングを100cにおいて10分間乾燥することにより5μm厚さの層が形成される。この被獲プレートを、光波として例1に使用されたハロゲンと使用し、線画像を通し像に合せ現で、次で例1に使用された現像を設立したとにより現像する。三塩化鉄溶液で腐蝕を行うことにより、耐蝕層で被緩滞れている層の未露光域を受すことなく、裸出網層を除去する。

適当な浴中で採出銷 層上に鉛 / 錫層を電着させた点以外は上記の方法を繰返す。 との耐蝕層もこの作業に対して抵抗性を有する。

*0*91 .3

層厚の大きいポジチブ作業のホトレジストを 製造するために、

例1 で使用されたノポラック 29.64 重量部

く。 すなわちアセトンで耐蝕層を除去すること によつてステンシルを除去する。 円筒形をとの 方法で処理する場合にはロータリースクリーン 印刷用の印刷版が形成される。

(%) 4

ブラッシングされた アルミニウムプレートを 例 1 で使用されたノボラック 10.6 4 重量部 ポリアセタール又はポリケタール

3.20重量部

2 - (4 - (2 - エトキシーエトキシ) - ナフト-1 - イル) - 4 ,6 - ビスートリクロルメチル-s - トリアジン 0.16 重量部をメチルエチルケトン 86.00 重量部
に容かした溶液に受演することによりコートする。

浴から引上げ、溶剤を蒸発させた後で同プレートを熱風流中で20秒間乾燥し、次いで1 mm 厚さのガラス板で獲われた線原画の下で解光する。解光装置は相互に4 cm の間隔を置いて配置されている4個の T L A K 40 W / 05型の螢光

灯(フィリップス(Philips)社により製造)から構成される。管形ランプの周辺とブレート面との間の距離は約5㎝であつた。種々のポリアセタール及びポリケタールのために使用された錫光時間を下記の表に示す。

化合物	露光時間 (秒)	化合物	課光時間 (秒)
11	15	37	21
15	22	40	18
16	19	41	. 4
17	. 5	42	13
21	10	44	10
24	5	45	40
25	105	46	93 .
27	10	47	23
28	13	48	26
29	9 .	49	25
30	7	50	5
31	11	51	16
32	17	52	20
33	14	53	17
34	25	54	. 7
35	40	55	3

特開昭53-133429(21)

56	19	80	7
57	10	81	6
58	46	82	44
59	'7	83	13
60	. 5	84	10
61	. 3	85	7
62	5	86	. 12
63	. 5	. 87	15
64	4	88	12
65	. 5	89	37
66	3	90	35
67	4	91	25
68	3	92	43
69	· 7	93	90
70	4	95	8
71	75	97	8
72	4	101	70
73	. 8	102	17
74	12	103	9
75	8	104	17
76	3	105	30
77	3	106	32
78	3		
79	10		

このすべての場合に例1で使用された現像液Aで現像した後で原画のポッチプ像が形成される。

例 5

例1で使用されたノボラックの代りに、DIN (ドイッ工業規格)53181により測定した 融点範囲110~120℃を有するフェノール ホルムアルデヒドノボラックを同重量使用する 点以外は例4の方法を繰返す:

1 8 3 12 4 22 7 25 22 20 28 5 36 9 98 30 39 10	化合物	露光時間(秒)
4 22 7 25 22 20 26 5 36 9 98 30	1	8
4 22 7 25 22 20 26 5 36 9 98 30	3	12
22 20 26 5 36 9 98 30	4	22
26 5 36 9 98 30	7	25
26 5 36 9 98 30		20
98 30		. 5
• • • •	. 36	9
39 10	98	30
		10

との場合にもコピー組成物はポジチブ作業で ある。

例 6

オフセント印刷版を以下の様にして製造する: 電解法で粗面にされ、陽極処理されたアルミニウム箔に下記のコーテイング密液をウアーラー法(150回転/分)によりコートする:

メチルエチルケトン9 4.6 重量部例1で使用されたノボラック4.0 重量部化合物 &81.2 重量部

例1で使用された酸供与体化4

クリスタル ヴァイオレット 0.01 重量部形成された階は約1.5~2.0 g/ mの乾燥重量を有する。この乾燥感光材を1100mの距離をおいた5 k Wのハロゲン化金属ランプを用いてポッチプ線及びスクリーン組合せ原画の下で20秒間踏光する。緩光後に強い青緑色コントラストを示す像が見える様になる。例1の現像液 A を現像用に使用する。層の露光域が印刷ステンシルとして残る。

との方法で製造されたオフセット印刷版に常

法で油性インキを付着させ、印刷機に締めつける。版を保存すべき場合には常用の保存剤で拭うことが出来る。110000ブリント後に、150ドントスクリーンに損傷は認められなかつたが、印刷を中止した。現像された印刷版を約230~240℃で後加熱することにより印刷運転時間を著しく増すことが出来る。

例 7

0.2 重量部

おける物質の保存性の迅速テストとして考慮さ

世解法で相面にされ陽極処理された表面を有 するアルミニウムブレートに以下の組成:

7 3.8 % 例1で使用されたノポランク モノマー又はポリマーアセタール 223% 例2で使用された酸供与体 3.7 % 0.2 % クリスダル ヴアイオレツト をメチルエチルケトンに溶かした6%溶液をウ アーラーコーテイング法により塗布し、約2μm 厚さの被覆層を形成する。全ブレートを乾燥機 中で等しい時間100℃に加熱し、原國下で蘇

下記の第7表は熱応力の継続時間の函数とし てのプレートの現像所要時間の変化を示す。



光し、次いで現像する。

0.02重量部 9 3.0 5 重量部 プタンー2ーオン からなる溶液で約1.7 μm厚さの乾燥層が形成 される様にコートする。 5 μ m 直径のスポット 上に光学的に焦点を合せたビームを有する25 Wのアルゴンーイオンレーザーを用いて上記の 層を像に合せて全スペクトル線にわたり照射す る。レーザーのレコーデイング速度を変えてポ リアセタール/酸供与体配合物の感度を測定す る。例1の現像液Aを使用する場合には、腐の 鮮光域は15~90秒以内で溶解し去る。未照 射域に油性インキを歯布することによりレーザ - のトレースを更に明白にすることが出来る。 下記の最高レコーデイング速度が観察された:

	配	· 合	物		レコーデイング 速度(m/秒)
化合物 M9 2 . 5 ジェ ゼンージアン	トキシー			·ノルカブトベン ¥酸塩	100
化合物系1:	9 <i>ኤየ</i> ኦ				

2-(4-エトキシナフト-1-イル)-4,6-ビ トリクロルメチルーョートリアジン

		第	7		投				<u>.</u>		
•	Ms.	モノマー 又は ポリマーアセタール	例1の 現像被		ъ:	現	時間(像(b	秒)	b b	a	h ·
•	1	ビスフェノールーA - ビスー テトラヒドロビラニルーエー テル	В	0	30	30	90	60	150	100	150
	2,	ジー(4ーヒドロキンフエニル)ースルホンービスーテト ラヒドロビラニルーエーテル	В.	o	40	30	180	60	210	100	310
	3	化合物 派8	A	0	40	30	40	60	40	100	40
	4	化合物 /6.99	Α	0	15	30	15	60	15	100	15

テスト 161 及び 2 において例1 の現像液 13 の 代りに侵蝕性のより少ない現像液Aを使用する 場合には、現象所要時間は更に著しく増す。

電解法で租面にされ、陽極処理された表面を 有するアルミニウムブレートをウアーラーコー ティング法により以下の組成:

例1で使用されたノボラック	4.	7	重 戲部
ポリマーアセタール	1.	4	重量部
酸供与体	0. 2	3	重量部

化合物 版 12及び			
4-(4-メトキシスチリル)-6-トリクロルメチ	•	45	
i. i. i. 2-+-/			

との例は酸によつて分離され得る新規化合物 を含有する隣の電子ビームによる像形成を示す

以下的租赁和。	
例1で使用されたノポランク	7 4.0 %
ポリマーアセタール	2 2 0 %
開始剤	3.8%
築 料	0, 2 %

からなる約2 um厚さの層を11 K V 電子で照 射し、照射域を第8表に記載の条件下で溶解化 する。

***	_	100
第	- 8	表

化合物		照射エネルギー (シュール/cd)	る現像液	現像時間 (秒)
10	2ー(pーメトキシスチリル)- 4,6ービスートリクロルメチル ーsートリアジン	1-5 ·10-2	Α	45

10	2,5ージエトキシー4ーpート リルメルカプトペンゼンージアゾ ニウム ヘキサフルオ燐酸塩		Α .	45
12	2-(4-エトキシナフトー1- イル)-4・6-ビスートリクロ ルメチルー5-トリアジン		В	10
18	4-(2,4-ジメトキシースチ リル)-6-トリクロルメチル- ピルー2-オン		A	45
19	2,5ージエトキシー4ーpート リルメルカプトーペンゼンージア ゾニウムヘキサフルオ燐酸塩	1-15-10-2	В	15

スペクトルの比較的短い波長領域内で、すなわち可視光線領域を越えた領域内及び常用の光源の主輻射領域の外側域で吸収されるが、電子輻射の下で非常に活性のある酸供与体、例えばペンタプロムエタン及びトリスートリプロムメチルー s ートリアシンを使用する場合にも類似の結果が得られる。

本方法は層を通常の日光の下で取扱い得るという利点を有する。

例 10

二軸方向に延伸され、熱固定された25μm

トップコーディングで被覆することが出来る。 トップコーティングを除去した後でとのポジ チブ作業の乾燥耐蝕層を、35μm厚さの鋼層 を片面又は両面に備えた絶縁材からなる予熱さ れた清潔な支持体に市販の積層機を用いて積層 することにより配線板を製造することが出来る 。支持フィルムを剝離し、場合により乾燥して から、原画の下で5KWのハロゲン化金属ラン プ(110㎝距離、約100秒間)に露光し、 例1で使用された現像液A一とれに小量のブタ ノールを添加してもよい一を約2~4分間噴霧 して現像することにより高品質の像形成された 耐触層が得られる。これは例えば FeCl3 を使用 する触刻作業の間の条件に耐性を有するばかり でなく、通し孔印刷配線を製造するために使用 される電気メッキ作業に対しても、特に鍋屉及 びニッケル層が相前後して電気メッキされる場 合化、耐性を有する。

例 11

再引伸し版を製造するためには、

呼さのポリエチレンテレフタレートフイルムを、トリクロル酢酸 1 0 %、ポリビニルアルヨール 1 % 及び湿潤剤 0 1 % を含有する水溶液中に受し、次いで同フイルムを 1 4 0 ℃ において 2 分間乾燥する。

ポッチブ作業の乾燥耐蝕層を製造するためには、その様に前処理されたポリエステルフイルムをメチルエチルケトン46重量部とジオキサン14重量部との混合物中に溶かした以下の成分:

例 1 で使用されたノボランク 2 8.6 in 電部 化合物 & 2 8.6 in 電部 例 3 で使用された酸供与体 0.5 in 最 部 例 2 で使用されたコーテイング補助物質

2.1 重量部

染料としての" C.I. ソルヴェント ブルー M 1 6" 0.2 重量部の溶液でコートする。同被環際は乾燥後に約40~50μmの厚さを有する。埃及び引播きに対して保護するために、同層をポリエチレンの

 例1で使用されたノボランク
 4.0 電景部

 化合物 & 10
 1.2 電景部

 2-(4-エトキンナフトー1ーイル)-4
 6-ビスートリクロルメチルーs-トリアンン

 0.2 重量部

 クリスタル ヴアイオレント
 0.01 重備部

をメチルエチルケトン 8 4.6 度号部に密かし、 同溶液をプラッシングされたアルミニウムプレ ート上にウアーラーコーテイング法によりコー トする。

その様に形成されたブレートを、150ワットのランプを備えているライッ(Leitz)社供給の投影機(Prado型、エ=85㎜、1:25)を用い65㎝の距離から透明ポジチブの下で3分間観光する。例1に記載の現像液A中に受すことにより透明ポジチブ上に黒白線画像の引伸ばされたコピーが60秒以内で得られ、その様に製造されたコピーは小型オフセット印刷機内で印刷することにより製版することが出来る

特開昭53-133429(24)

化合物が10の代りに等量の化合物が14、 19、8、38、20、94又は99を使用す ることによつても類似の結果が得られる。

第1頁の続き 砂発 明 者 ハンス・ルツケルト ドイツ連邦共和国ナウロート・ エルプセンアツカー21

(ほか1名)